

X線回折装置 (XRD) (リガク : Smart Lab)

1次元X線検出器 (D/teX Ultra 250) により高速測定が可能です。

粉体試料の θ - 2θ X線回折のほか、光学パーツを組み替えることで薄膜試料のロックングカーブ解析、逆格子マップ、極点、インプレーン回折、反射率解析、小角散乱など多様な薄膜評価手法に対応します。

また、測定データの解析には、PDXL2、ICDD、NANO-Solver、3D Explore、GlobalFitがインストールされています。

※B-051 (X線回折装置解析PC) にも、これらのソフトウェアが導入されていますので、解析に長時間かかる場合にご利用ください。



【仕様】

X線管球	銅 (回転対陰極式)
最大定格出力	45kV、200mA (9kW)
最小ステップ	0.0001°
ゴニオメータ半径	300mm
光学系	CBO光学系切り替えユニット (集中法、平行ビーム法)
ステージ	標準粉末用高さ基準試料板、透過小角用試料板、4インチウェーハ用試料板
検出器	シンチレーションカウンタ、1次元半導体検出器 (D/teX Ultra 250)
その他	Cu用カウンタモノクロメータユニット (シンチレーションカウンタ用) Cu-K β 用フィルター

設置場所 C10棟 215室

カテゴリー 計測